Historia Corporativa y Desarrollo de Infraestructuras

1975
Creació del Servei de Microscòpia Electrònica

1975
TEM Hitachi HU12A
Primer TEM de la UAB.
Voltaje de aceleración de 75 kV.

1976
Obertura de portes

1982
SEM ISIS Super IIIA
Primer SEM de la UAB.

1986
SEM Hitachi S570
Mejor resolución respecto equipos anteriores.
Fotografía con negativo 6x7.

TEM Hitachi H-7000
Voltaje aceleración 125 kV.
Difracción de electrones con porta-muestras inclinable.

1994
SEM Jeol
Primer SEM con imagen digital.
Incorporación de la técnica EDX.

1996
Confocal Leica TCS 4D
Primer microscopio Confocal de la UAB.

2001
Servei de Microscòpia

servei Microscòpia

2002
Confocal TCS SP2
Sistema espectral AOBS.

2003
Lupa Leica MZFIII
Incorpora luz transmitida, reflejada, fluorescencia y polarización.

2004
TEM Jeol 2011
Primer TEM de alta resolución de la UAB.
Voltaje de aceleración 200 kV.
Observación de muestras en condiciones criogénicas.

2005
TEM Jeol JEM-1400
Voltaje de aceleración de 120 kV.

2006
Confocal Leica TCS SP5
Primer confocal totalmente automatizado.
Módulo de alta velocidad.
Módulo de Multifotón.

2007
Confocal Olympus FV1000
Incorpora técnica TIRFM.

2010
SEM ZEISS EVO MA10
Presión variable.

SEM ZEISS Merlin
Primer SEM de alta resolución de la UAB.
Filamento de emisión de campo.
Incorpora difracción de electrones retro-dispersados (EBSD).

2020
Confocal ZEISS LSM 980
Primer confocal con superresolución (Airyscan 2)
Módulo de PicoQuant

2024
Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X

2024
Ultramicrotomo Boeckler PowerTomePC
Ultramicrotomo con módulo de crio.

2025
Escáner de portaobjetos Olympus SLIDEVIEW VS200
Incorpora campo claro, campo oscuro, fluorescencia y polarización.

Evident IX85 – ScanR
Campo amplio automatizado (CellSens).
Incorpora un sistema de cribaje de alo contenido (ScanR).

1980 1990 2000 2010 2020

Elaborado por: Meritxell Vendrell Flotats